平成11年(ワ)第28963号 特許権侵害差止請求事件 口頭弁論終結日 平成13年2月26日

业用

刊	决				
原告	•	日亜化	学工業株式	式会社	,
同訴訟代理人弁護士		品	낀	澄 和	雄
同 同		山吉青河石北	上 利	靖	則雄葆治夫廣
同補佐人弁理士		青		- 13	葆
同		河	宮	_	治
同 同		白北	山 宮 井 原	久 康	天座
向 被 告		ル 住友商語	- 原 事株式会	· 决 计	庚
同訴訟代理人弁護士		灘		修	_
同		内	藤	順	也
同同		与	波 藤 養 波	雅	大修
同		超	山	哲	也夫修宏哉樹
同		村	田	哲 哲 芳	哉
同補佐人弁理士		長谷) 	芳 伊 知	樹 良
同 被告補助参加人		近 クリー	藤 • インク	伊知	艮
同訴訟代理人弁護士		升	・インク 永 島 岩	英	俊
同		大 ₋	島	崇	俊志子
同 同補佐人弁理士		内鳥岩西村長近ク升大大谷加谷 一	宕	英 崇 直 義 信	子
同		加	藤	信	之
同	_	南	条	嶊	之 裕
主	文				

汝

第1 原告の請求

1 被告は、別紙「物件目録」記載の青色発光ダイオードチップ(青色半導体発光素子)を販売してはならない。

2 被告は、その所有に係る前項記載の青色発光ダイオードチップ(青色半導体発光素子)を廃棄せよ。

第2 事案の概要

本件は、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の特許権を有する原告が被告に対し、被告補助参加人が製造し、被告が販売している別紙「物件目録」記載の青色発光ダイオードチップ(以下「被告製品」という。)は、原告の上記特許権に係る発明(請求項1、3)の各技術的範囲に属するものであり、その販売が原告の上記特許権の侵害に当たると主張して、上記特許権に基づき、被告製品の販売の差止め及び廃棄を求めている事案である。

1 争いのない事実

(1) 原告は、下記の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。 記

特許番号 第2918139号

発明の名称 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

出願日 平成5年6月17日 登録日 平成11年4月23日

(2) 本件特許権に係る明細書(以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の特許公報(甲2)参照)の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりである(以下、この発明を「本件発明1」という。なお、「半導体発光素子」とは、電流を流すことによって発光する半導体素子のことであり、発光ダイオードとも呼ばれる。「ドーパント」とは、半導体の性質を制御するために添加される、半導体結晶を構成する元素以外の元素からなる不純物のことであって、GaN、GaAsのようなⅢ-V族化合物半導体に対しては、p型のドーパントとして、Ⅱ族元素であるBe、Mg、Zn、Cdがあり、n型ドーパントとしては、Ⅵ族元素であるSe、

A I x N (0≦X<1, X<Y, X<Z)層を発光層として具備することを特徴と する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」

(3) 本件明細書の特許請求の範囲請求項3の記載は、次のとおりである(以 下,この発明を「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件発明」と総称す る。なお、「コンタクト層」とは、電極と半導体との電気接続を行う半導体層のこ

とである。

「前記p型GaューzAlzNの上に,さらにコンタクト層としてp型GaN 層が積層されていることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導 体発光素子。」

- (4) 本件発明1の構成要件を分説すれば、次のA1及び2、B並びにC記載の とおりであり、本件発明2の構成要件を分説すれば、次のA1及び2、B、C並び にD記載のとおりである(以下、分説した各構成要件をその符号に従い「構成要件 A 1」などのように表記する。)。
 - n型Ga1-YAIYN(0<Y<1)層と A 1

p型Ga1-zAIzN(O<Z<1)層とを有すること

B 上記両層の間にn型ドーパントとp型ドーパントとがドープされたn型 Ga1-×AI×N(O≦X<1, X<Y, X<Z)層を発光層として具備すること 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であること

上記p型Ga1-zAIzNの上に、さらにコンタクト層としてp型Ga N層が積層されていること

(5) 本件発明は、次のような作用効果を有する。

従来のMIS構造(半導体表面に絶縁膜を挟んで金属電極を対向させた 構造)の発光素子に比して、格段に発光出力が向上する。

イ AIGaNからなるp型クラッド層の上にコンタクト層としてp型Ga N層を形成することにより、正電極とp型コンタクト層とのオーミック接触(オーミックとはオームの法則に従うという意味で、その接触部分に整流性がないことを意味する。)が得られやすくなり、発光素子にかかる順方向電圧を下げ、発光効率 を向上させることができる。

ウ SiC, MIS構造GaNしか利用されていなかった従来の青色発光素 子にとって替わり、本件発明の発光素子が十分に実用可能となり、平面ディスプレ イ,フルカラー発光ダイオード等が実現できる。

- (6) 被告補助参加人は、被告製品(その構成は、別紙「物件目録」記載のとお りである。)を日本国外で製造して被告に販売し、被告は、これを日本国内で販売 している。
- (7) 被告製品は、構成要件A2、C及びDを充足する(被告製品の層60が構成要件A2の「p型GaAIN層」に、層70が構成要件Dの「p型GaN層」に それぞれ該当する。)。

被告製品が構成要件A1及びBを充足し、本件発明の技術的範囲に属するか どうか。

本件発明の技術的範囲がいわゆるダブルヘテロ構造(活性層ないし発 光層と呼ばれるバンドギャップの小さな層を、クラッド層と呼ばれるバンドギャッ プの大きなp型及びn型の層で両側から挟んだ接合構造)の半導体発光素子に限定 され、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN 層」がいずれもクラッド層であることを要し、また、構成要件Bの「上記両層の間 に」という構成がn型GaAIN層とp型GaAIN層の双方に発光層が直接に接 触していることを要するものかどうか。 3 原告の主張

被告及び被告補助参加人(以下「被告ら」という。)は、本件発明がいわ ゆるダブルへテロ構造の半導体発光素子に限定され、構成要件A1の「n型GaA IN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」がいずれもクラッド層であるこ と、構成要件Bの「上記両層の間に」という構成がn型GaAIN層とp型GaA IN層の双方に発光層が直接に接触していることを要すると主張する。

しかし、そもそも本件発明の本質は、従来のMIS構造の発光素子ではi型層にZnとSiとをドープしても発光色を変え得るのみであり、発光素子として

したがって、被告らの主張は失当である。

- (2) 仮に、構成要件A1の「n型GaAIN層」及び構成要件A2の「p型GaAIN層」がクラッド層であることを要するとしても、そもクラッド層とは、レーザーダイオードにおいて光を増幅する機能を持つ活性層(発光層)の周囲に隣接若しくは近接して存在する屈折率が低くバンドギャップエネルギーが高い半導体層であり(甲第4号証「半導体用語大辞典」376頁参照)、せき止め機能(p型層やn型層が一種の窓として機能で発生した光の自己吸収が少なく、効率よく光を取り出せる機能で表光層で発生した光の自己吸収が少なく、効率よく光を取り出せる機能である。発光層で発生した光の自己吸収が少なく、効率よく光を取り出せる機能である。本代明報書においても、実施態様としてクラッド層が発光層に接している例が記載されているにすぎず、n型GaAIN層が発光層に直に接していなければならないとは記載されていない。
- (3) 被告製品は、層30が構成要件A1の「n型GaAIN層」に、層50が構成要件Bの「<math>n型GaAIN層」にそれぞれ該当し、構成要件A1及びBを充足する。そして、<math>ZnとSiがドープされてキャリア濃度が調整された発光層50に、n型AIGaN組成傾斜層30側から電子を、p型AIGaN層60側から正孔を供給し、その結果ドナーアクセプタのペア発光を生ぜしめて発光出力を向上させるものであり、本件発明の作用効果を奏している。

仮に構成要件A1の「n型GaAIN層」及び構成要件A2の「p型GaAIN層」がクラッド層であることを要するとしても、被告製品のp型AIGaN層60はクラッド層であり、n型AIGaN組成傾斜層30も、発光層50より屈折率が低く、バンドギャップエネルギーが高い層であり、発光層50に隣接してはいないもののそれに近接して存在しており、層30と層40との間の電位障壁によるせき止め機能(甲第6号証参照。なお、層40自身は、クラッド層として機能しない。)と共に、窓機能を有しているから、クラッド層に当たり、構成要件A1の「n型GaAIN層」に該当する。

したがって、被告製品は、構成要件A1及びBを充足し、本件発明の技術的範囲に属する。

4 被告らの主張

(1) 本件発明は、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載(段落【OOO 1】、同【OOO6】、同【OO10】、同【OO13】ないし同【OO15】及び同【OO34】等)から明らかなように、ダブルヘテロ構造の半導体発光素子に関するものであり、シングルヘテロ構造の半導体発光素子を対象とするものではない(本件明細書には、シングルヘテロ構造のものであっても従来技術によっては解決できなかった技術的課題を解決できる旨の記載はなく、その示唆もない。)。この点は、本件発明の発明者である丁Ⅱが、本件発明の特許出願時においてそのよう

な認識であったことからも明らかである(丁II 作成の陳述書(丙5)参照)。そして、クラッド層とは、発光層(活性層)を被覆する層であって、発光層(活性層)の小さいバンドギャップと比べて、そのバンドギャップがより大きな層であり、発 光層とヘテロ接合すること、すなわち、介在層なしに直接に接合することにより、 発光層の境界において電位障壁を設けるように機能するものを意味し、ダブルヘテ ロ構造の半導体発光素子における発光層(活性層)は、p型クラッド層とn型クラッド層によって直接接触した状態において挟まれているものである。

したがって、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」は、いずれもクラッド層であることを要し(このことは、本件明細書の段落【0007】及び同【0009】の記載からも明らかである。)、構成 要件Bにいう「上記両層の間に」とは、構成要件A1の「n型GaAIN層」 成要件A2の「p型GaAIN層」の双方に直接に接触する態様において発光層を 具備すること、すなわち、n型GaAIN層と発光層との間、p型GaAIN層と発光層との間に、いずれも他の層が何ら介在しないことを要するというべきであ

被告製品において、Mgドープp型GaAIN層60は、クラッド層であ る。しかし、Siドープn型GaAIN組成傾斜層30は、発光層50と直接に接 触する態様のものではなく、バッファ層を形成するものであって、発光層との関係 においてクラッド層としての役割を果たしていない。また、発光層50と直接に接触するSiドープn型GaN層40は、クラッド層として発光層に電子及び正孔を閉じ込める働きをするものではない。そもそも、被告製品においては、発光層50の膜厚が約4000オングストロームであるため、p型型にない層60から注入 された正孔が発光層50の内部で再結合し、発光層の片側においてクラッド層によって電子及び正孔をせき止める必要が全くない。被告製品においては、Siドープ GaN層40がバッファ層から発光層までの転移層として機能し、これによって発 光層の結晶構造が良くなり、その結果発光輝度が向上するものである。

以上のとおり、被告製品は、n型ドーパントのSiとp型ドーパントのZ nとがドープされたn型GaN層50を発光層として具備することを特徴とするシングルへテロ構造の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であり、構成要件A1及 びBを充足せず,本件発明の技術的範囲に属しない。 当裁判所の判断

1(1) まず、本件発明の技術的範囲がダブルヘテロ構造の半導体発光素子に限定 され、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN 層」がいずれもクラッド層であることを要するものかどうかについて検討する。

確かに、本件明細書の「特許請求の範囲」には、本件発明がダブルヘテロ 構造の半導体発光素子に限定され、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」がいずれもクラッド層であることを要する旨の明文 の記載はない。

しかし、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、次の記載がある(甲

第2号証によって認められる。)。 ア 「【産業上の利用分野】本発明は窒化ガリウム系化合物半導体を用いた 発光素子に係り,特にp-n接合を有するダブルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合

物半導体発光素子に関する。」(段落【〇〇〇1】)

イ 「【発明が解決しようとする課題】・・・・p型ドーパントであるZnをドープし、さらにn型ドーパントであるSiをドープして高抵抗なi型GaAIN層を発光層とするMIS構造の発光素子は輝度、発光出力共低く、発光素子として実用化するには未だ不十分であった。」(段落【〇〇〇4】)

「【課題を解決するための手段】我々は、GaAINを従来のように高 抵抗なi型の発光層とせず、低抵抗なn型とし、新たにこのn型GaAIN層を発光層としたp-n接合ダブルヘテロ構造の発光素子を実現することにより上記課題 を解決するに至った。即ち、本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子はn型 $Ga_{1-Y}A_{1-Y}N_{1-Y$ ≦X<1, X<Y, X<Z)層を発光層として具備することを特徴とする。」 落【0006】)

「本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、クラッド層 であるn型Ga1-YAIYN層(以下, nクラッド層という。)とは, GaAINに例えばSi, Ge, Se, Te等のn型ドーパントをドープしてn型特性を示す

ように成長させた層をいう。」(段落【0007】) _ オ 「同じくクラッド層であるp型Ga1-zAlzN層(以下, pクラッド)とは、GaAINにZn、Mg、Cd、Be、Ca等のp型ドーパン トをドープして、p型特性を示すように成長した層をいう。」(段落【000 9])

「【作用】・・・・p型ドーパントとn型ドーパントをドープしたn発光層 を具備するダブルヘテロ構造窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の場合, n 発光 層の電子キャリア濃度により発光素子の発光出力が変化する。発光出力はn発光層の電子キャリア濃度が10½/cm² 付近より急激に増加し、およそ1×10½~10½/cm² 付近で最大となり、それを超えると再び急激に減少する傾向にある。現 在実用化されているn型GaNとi型GaNよりなるMIS構造の発光素子の発光 出力は、本発明の発光素子の最大値の発光出力のおよそ1/100以下でしかな く、また実用範囲を考慮した結果、電子キャリア濃度は1×10¹⁷/cm³ ~5×10¹²/cm³ の範囲が好ましい。〈中略〉電子キャリア濃度を調整することにより発光出力が変化するのは、p型ドーパントであるZnの発光中心がドナー不純物とペアを作って発光するD-Aペア発光の可能性を示唆しているが、詳細なメカニズム はよくわからない。重要なことは、ある程度の電子キャリアを作るドナー不純物 (例えばn型ドーパント,ノンドープGaAIN) と,アクセプター不純物である p型ドーパントとが両方存在するn型GaAINでは、ダブルヘテロ構造の発光素 子において、発光中心の強度が明らかに増大するということである。」(段落【0 [0015]) 014],

キ 「【発明の効果】・・・・本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、p型ドーパントおよびn型ドーパントをドープしたn型Ga1-×AI×N層を発光層とするダブルへテロ構造としているため、従来のMIS構造の発光素子に比

して、格段に発光出力が増大する。」(段落【0034】)

(3) 本件発明は、n型ドーパントとp型ドーパントとがドープされたn型Ga 1-xAlxN層, n型Ga1-yAlyN層及びp型Ga1-zAlzN層について, 「X<Y」、「X<Z」の関係をその構成要件としている。そもそも、ダブルヘテロ構造とは、活性層ないし発光層と呼ばれるバンドギャップの小さな層を、クラッ ド層と呼ばれるバンドギャップの大きなp型及びn型の層で両側から挟んだ接合構造であり、このような構造の発光素子においては、発光層とクラッド層との間にギ ャップ差に基づく電位障壁が生じ、それによって電子及び正孔がせき止められる。 そして,その結果,通常,電子及び正孔が活性層外に拡散できずに発光層内に閉じ こめられ (n型クラッド層から発光層に供給された電子がp型クラッド層へ拡散し p型クラッド層から発光層に供給された正孔がn型クラッド層へ拡散しに くい。)、発光層内の電子及び正孔の密度が上がり、わずかな電流でも高い輝度の発光が得られることになる(甲第3号証、丙第1、第3、第5号証及び弁論の全趣旨によって認められる。)。また、バンドギャップの大きさは、それぞれの物質に よって決まっており,GaAINにおいては,AIの混晶比が大きくなるほどバン ドギャップも大きくなる(弁論の全趣旨によって認められる。)。そうすると、本 件発明がn型ドーパントとp型ドーパントとがドープされたn型Gai-xAIxN 層, n型Ga1-YAIYN層及びp型Ga1-zAIzN層について, X<Y, X<Z

仮に,本件発明がシングルヘテロ構造のものも含むとした場合には,本件 発明がn型GaAIN層の存在や、上記のようなAIの混晶比の関係をその構成要 件としている理由について、説明が困難である。

- (4) 前記(2) 認定の本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載に上記(3) の 点を併せ考えれば、本件発明は、ダブルヘテロ構造の半導体発光素子に限定され、 構成要件AIの「n型GaAIN層」及び構成要件A2の「p型GaAIN層」
- が、いずれもクラッド層であることを要するというべきである。 (5) 原告は、本件発明の本質について、従来のMIS構造の発光素子では i 層 にZnとSiとをドープしても発光色を変え得るのみであり、発光素子としては実 用できないことから、発光層にp型ドーパントのZnとn型ドーパントのSiとを共にドープしn型とすることによって、発光層の電子キャリア濃度を調節して、発光素子の発光出力を向上させるという点にあり、本件発明は、クラッド層を必須と

するものではない旨を主張する。

2 次に、構成要件Bの「上記両層の間に」という構成が、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」の双方に発光層が直接に接触していることを要するものかどうかについて検討する。 前判示のとおり、本件発明は、ダブルヘテロ構造の半導体発光素子に限定さ

前判示のとおり、本件発明は、ダブルヘテロ構造の半導体発光素子に限定され、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」がいずれもクラッド層であることを要するが、ここでクラッド層とは、ダブルヘテロ構造の技術的意義に照らせば、発光層のバンドギャップよりもバンドギャップが大きく、そのギャップ差に基づく電位障壁によって電子及び正孔をせき止める機能を有する半導体層を意味するものというべきである。

では、クラッド層について、発光層と介在層なしに直接に接合することにより、発光層との境界においてて電位障壁を設けるように機能するものを意味する旨を主張するが、一般にクラッド層が発光層と介在層なしに直接に接合し、電位障壁が発光層との境界においてのみ生じなければならないことを示す証拠はなく、かえって、甲第4、第6号証、丙第6、第7、第12、第13号証には、発光層直接に接合していないものであってもクラッド層に該当し得ることが示されている。本件明細書においても、構成要件A1及びA2の各GaAIN層がいずれも発光層に直接接触していなければならない旨が記載されているものではない。

したがって、本件発明において、構成要件A1の「n型GaAIN層」と構成要件A2の「p型GaAIN層」は、いずれも発光層に直接接触している必要はなく、両層が発光層を両側から挟んで前記のようなせき止め機能を発揮するのであれば、発光層との間に他の層が介在しても、上記n型GaAIN層、p型GaAIN層及び発光層は、構成要件A1、A2及びB所定の各層に該当するというべきである。

前記のように、クラッド層とは、発光層のバンドギャップよりもバンドギャップが大きく、そのギャップ差に基づく電位障壁によって電子及び正孔をせき品の N機能を有する半導体層を意味するというべきである。したがって、被告製品の N層」に該当するかどうかは、n型GaN層40がクラッド層として機能しない上(この点については争いがない。)、層30が層40との間に生じた電位障壁によって正孔をせき止める機能を有しているかどうかによって判断されるべきものであるが、このような正孔をせき止める機能は、正孔の拡散長や層の厚さによってあるが、このような正孔をせき止める機能は、正孔の拡散長や層の厚さによって認められる。)。

旨によって認められる。)。 甲第6号証(丁皿教授作成の鑑定書)には、n型GaAIN層と発光層の間に介在する層(介在層)が発光層と同じバンドギャップの窒化ガリウム系化合物半導体層である場合には、介在層と発光層との間に電位障壁が生じるものでなく、介在層と<math>n型GaAIN層との間の電位障壁によって正孔がせき止められるとして、被告製品のように、n型Ga1-YAIYN(O<Y<1)層とp型Ga1-ZAIZN(O<Z<1)層とが、n型Ga1-XAIXN($O\leq X<1$,X<Y,X<Z)発光層に隣接していないものも、本件発明の技術的範囲に属すると考えられる旨の記 載がある。しかし、甲第6号証は、n型GaAIN層と発光層の間に介在する層のバンドギャップと発光層のバンドギャップの大小のみを問題にしたものであり、発光層50、<math>n型GaN層40及びn型GaAIN組成傾斜層30それぞれの厚さや、正孔の拡散長を何ら考慮していない。この点に照らせば、甲第6号証は、被告製品の層30が構成要件A100「n型GaAIN層」に該当することを認めるに足りるものではない。

また、甲第5号証(TIV教授作成の鑑定書)には、正孔の拡散長を特定することは、現在のところ不可能である旨が記載されている。しかし、そうであるならば、層30が層40との間に生じた電位障壁によって正孔をせき止める機能を有しているかどうかを判断し得ないことになり、被告製品の層30が構成要件A1の「n型GaAIN層」に該当することを認めることもできないというべきである。

したがって、被告製品の層30が構成要件A1の「n型GaAIN層」に該当すると認めることはできない。

4 以上によれば、被告製品は、構成要件A1を充足せず、本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。

よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 村 越 啓 悦

裁判官中吉徹郎は、転任のため署名押印できない。

裁判長裁判官 三 村 量 一

物件目録

青色発光ダイオードチップ

1 構成の説明

基板10の裏面にはn電極90が形成されており、さらにコンタクト層70の表面にはp電極80が形成され、n電極90とp電極80との間に電流を流すことには2000年に表示するよう。

により430nm付近の青色を発光する。

図面符号の説明 2

図面付与の説明 図面の示す構成部分は、以下のとおりである。 10····SiC単結晶からなる基板 20····Siがドープされたn型GaAIN層 30····Siがドープされたn型GaAIN組成傾斜層 40····Siがドープされたn型GaN層

50····Zn及びSiがドープされたn型GaNからなる発光層 60····Mgがドープされたp型GaAIN層 70····Mgがドープされたp型GaNからなるコンタクト層

80…p電極 90…n電極

図面(平面図) 図面 (断面図)